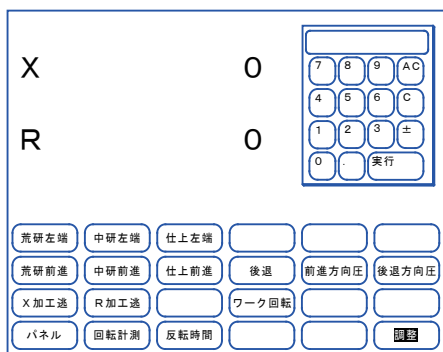


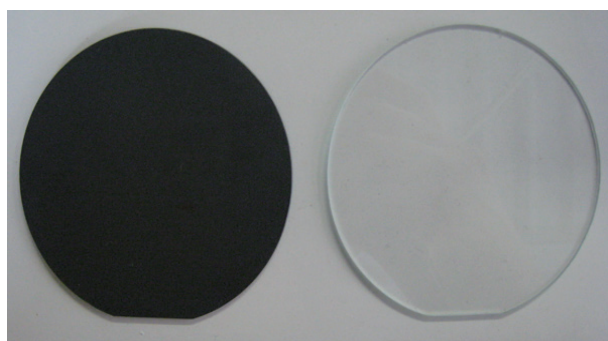


PEG-100-3S

FUJI GANKYO KIKAI MFG. CO. LTD
OSAKA, JAPAN

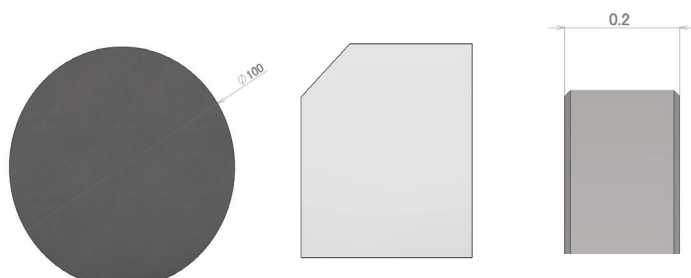
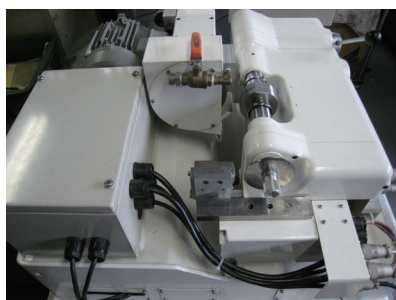


9.4インチタッチパネルを採用。
又、テンキーで数値を入力するだけで、
取り代を簡単に変更できます。



シリコンウェハー ガラス

ダイヤモンド砥石なのでシリコンウェハーやガラスはもちろん
水晶や金属等色々な素材に高精度(真円度5μm)に
加工可能。



微い加工方式なので様々な形状の加工が可能。
又、加工圧を簡単に変更していただけるので、
薄い物からφ100の物までチッピング無く加工可能。

型式	PEG-100-3S
工機サイズ	1322(W)×930(D)×1115(H)
加工機重量	350Kg
研削方法	型ゲージによる微い研削
本体サイズ	780(W)×704(D)×390(H)
主軸仕様	
駆動モートル	3φ200V 400W 4P
スピンドル回転数	4000rpm at 60Hz
砥石取付部軸形状	1/5テーパ (φ18.5×40(L))
標準砥石径	φ130mm (周速1633m/min at 4000rpm)

ワーク回転軸仕様	
駆動モートル	100V 4W 4P
ワーク軸回転数	可変 (6~29sec/rev)
最大ワーク径	φ100mm
最大ワーク幅	20mm
ワークテーブル仕様	
研削工程	最大3段階 (選択切替可能)
研削方法	プランジ/トラバース (選択切替可能)
テーブルストローク	74mm (横方向)
	30mm (切込み方向)
座標値分解能	0.005mm (横方向)
	0.001mm (切込み方向)